Оптический профилометр IntoM OP500

Описание

IntoM OP500 в основном используется для высокоточного измерения волнистости и шероховатости поверхности нестандартных деталей. Благодаря комбинации пятиосевой передвижной платформы (перемещение оси XYZ, маятниковая поворотная платформа) и промышленных зажимов выпол-няется быстрое позиционирование в соответствии с предоставленной моделью изделия. Прибор может автоматически регулировать смещение пятиосной платформы в соответствии с заданным положением координат, введенным в программное обеспечение, позволяя измерительной головке с белым светом быстро перемещаться в указанное положение координат детали, и измерять и получать тестовые данные, которые затем будут проанализированы с помощью ПО для получения 2D/3D-данных о шероховатости и волнистости.

Технические характеристики

Модель прибора		**IntoM OP500**
Источник света		Белый свет LED
Система изображения		1024X1024
Интерференционный объектив		10X, 20X
Поле обзора		0.98 ммX0.98 мм (10X)
XY перемещающаяся платформа	Размер	400X400мм
	Диапазон перемещения	300X300мм
	Нагрузка	20кг
	Способ управления	Электрический
AB отклонение поворотной платформы	Отклонение оси	±90°
	Поворот оси	360°
	Нагрузка	10кг
	Способ управления	Электрический
Фокус оси Z	Ход	>100мм
	Способ управления	Электрический
Диапазон сканирования направления Z		10 мм
Разрешение направления Z		0.1нм
Повторяемость измерения Ra		0.005нм
Измерение шага	Погрешность индикации	0.5%
	Повторяемость	0.1%
Температура окружающей среды		0~40°C, градиент W2°C/ч
Температура окружающей среды		<70%
Примечание: параметры шероховатости получены путем измерения стандартного шаблона шероховатости в лабораторных условиях в соответствии со стандартом JJF1105-2018.		